

Développement d'un microsystème de micro-extraction liquide-liquide à interfaces stabilisées par patterning hydrophobe/hydrophile résistant pour l'analyse des radionucléides

C. Mariet, C. Guyon

▶ To cite this version:

C. Mariet, C. Guyon. Développement d'un microsystème de micro-extraction liquide-liquide à interfaces stabilisées par patterning hydrophobe/hydrophile résistant pour l'analyse des radionucléides. Journée chaire Areva - La Chaire PARISTECH "Ingénierie nucléaire" 201533, Feb 2015, Paris, France. cea-02506796

HAL Id: cea-02506796 https://cea.hal.science/cea-02506796

Submitted on 12 Mar 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



1. Equipe «Procédés, Plasmas, Microsystèmes, PSL*, Chimie ParisTech, IRCP, CNRS UMR 8247 C. GUYON, I. MABILLLE, S. CAVADIAS, W. ABOUSSAOUD (ATER), M. TATOULIAN

2. Laboratoire de développement analytique nucléaire isotopique et élémentaire *CEA/DEN/DANS/DPC/SEARS*C. MARIET, G. HELLE

3. Equipe Ressources et Matériaux pour un Monde Durable PSL*, Chimie ParisTech, IRCP, CNRS UMR 8247, G. COTE, A. CHAGNES





IR | Institut de Recherche de Chimie Paris



Développement d'un microsystème de micro-extraction liquide-liquide à interfaces stabilisées par patterning hydrophobe/hydrophile résistant pour l'analyse des radionucléides

C. MARIET (CEA) / C. GUYON (Chimie ParisTech)



Contexte : analyses radiochimiques



Objectif:

Miniaturiser l'extraction liquide-liquide pour les protocoles d'analyse



Stratégie:

Contrôler l'hydrodynamique: écoulements parallèles et phases séparées

Cas 1⁽²⁾: U(VI) / Aliquat[®] 336

- Echangeur d'anions
 - Cinétique rapide

Phase aqueuse :

- analyte : U(VI) 10⁻⁵ M
- milieu aqueux : HCI 5 M

Phase organique :

- extractant : Aliquat® 336 10⁻² M
- diluant : n-dodécane
- modificateur de phase : 1-décanol 1% (v/v)

CI-



Stratégie:

Contrôler l'hydrodynamique: écoulements parallèles et phases séparées

Cas 2⁽²⁾: Eu(III) / malonamide

- Extractant neutre
 - Cinétique lente

Phase aqueuse :

- analyte : Eu(III) 10⁻² M
- milieu aqueux : HNO₃ 4 M
- Phase organique :
 - extractant : malonamide 1 M
 - diluant : n-dodécane





Objectif: stabiliser et ralentir les écoulements

- →ralentir la phase aqueuse (à désenrichir): meilleure extraction
- →utiliser des débits plus faibles : économie de solvants

tout en conservant des écoulements parallèles et des phases séparées





Objectif: stabiliser et ralentir les écoulements Stratégie: fonctionnaliser les microcanaux

- →ralentir la phase aqueuse (à désenrichir): meilleure extraction
- →utiliser des débits plus faibles : économie de solvants

tout en conservant des écoulements parallèles et des phases séparées





1- optimisation du procédé de dépôts sur COC et verre

2- tests de résistance aux acides des revêtements hydrophiles (silice) et hydrophobes (Teflon like)



Modifications de surface par procédé plasma



Caractéristiques des films obtenus par polymérisation plasma :

- 1. Contrôle du degré de réticulation des couches déposées (résistance à solubilisation)
- 2. Dépôts fortement adhérent au substrat sous jacent



Modifications de surface par procédé plasma



Caractérisation des films obtenus par polymérisation plasma

Obtention de couches à propriétés hydrophiles/hydrophobes

résistantes aux attaques acides...

Acides testés : HCl et HNO₃ à 6 mol/L

Durées d'attaque : 2, 4 et 6 heures (en mode statique)





Caractère hydrophile amélioré
Reste hydrophile après attaque



Caractère hydrophobe amélioré
Reste hydrophobe après attaque

Elaboration de couche de type SiO₂ par dépôt plasma à pression atmosphérique











Disposif d'injection de précurseur



Dispositif financé par la chaire



Epaisseur des dépôts (Spectroscopic ellipsometry)

	Avant attaque	Après attaque HCl (2 heures)	Après attaque HNO ₃ (2 heures)
CFx/Silicium	12,7 nm	10,2 nm	10,6 nm
	± 0,4	± 0,5	± 0,4
Silice/Silicium	37,9 nm	37,0 nm	36,9 nm
	± 0,4	± 0,5	± 0,5



Epaisseur du dépôt quasiment inchangée après 2h d'attaque aux acides

Conclusions et perspectives



Optimisation du procédé sur <u>surfaces planes</u> de dépôts :

- hydrophiles (Si) et hydrophobes CF_x
- sur matériau de prototypage COC et sur verre

 Résistance à HCl et HNO₃ 6 M vérifiée (statique): intérêt du dépôt plasma

Il faut encore :

→Mise en œuvre en microcanal

• vérifier le recouvrement des parois verticales



<u>Déjà commencé</u> sur microcanal en verre Largeur= 1 mm profondeur \approx 120 µm



<u>À faire</u> sur microcanal en verre et COC Largeur= 100 μ m profondeur \approx 40 μ m

•vérifier la résistance aux acides en mode dynamique



1. Equipe «Procédés, Plasmas, Microsystèmes, PSL*, Chimie ParisTech, IRCP, CNRS UMR 8247 C. GUYON, I. MABILLLE, S. CAVADIAS, W. ABOUSSAOUD (ATER), M. TATOULIAN

2. Laboratoire de développement analytique nucléaire isotopique et élémentaire *CEA/DEN/DANS/DPC/SEARS* C. MARIET, G. HELLE

3. Equipe Ressources et Matériaux pour un Monde Durable PSL*, Chimie ParisTech, IRCP, CNRS UMR 8247, G. COTE, A. CHAGNES







Merci







G. HELLE



W. ABOUSSAOUD